

開示の要約

研磨装置および研磨方法

- 5 正確な研磨進捗を監視することができる研磨装置が開示される。研磨装置は、研磨パッドを支持する研磨テーブルと、研磨テーブルを回転させるテーブルモータと、基板を研磨パッドに押し付けて該基板を研磨するトップリングと、基板の研磨中に研磨パッド上を揺動しながら研磨パッドをドレッシングするドレッサと、ドレッサの揺動周期に相当する周波数を持つ振動成分を、テーブルモータの出力
- 10 電流信号から除去するフィルター装置と、振動成分が除去された出力電流信号に基づいて基板の研磨の進捗を監視する研磨監視装置とを備える。

図1